

Innovative Automated Semiconductor Handling Solutions

WS200型自動ウエハ枚葉移載装置

2つのカセット間のウエハを移載する卓上型の自動ソーターです。ウエハの破損や傷を軽減します。標準SEMI規格の出荷用カセット、プロセス用カセット、メタルカセットに対応。簡単なトレーニングで使用可能な柔軟性の高いシステムです。

<操作方法>

タッチスクリーンディスプレイで操作します 2つのカセットをステージにセットし搬送モードを選択します

- ・手動モード
- ・クイック搬送モード
- ・レシピモード

真空レスの低接触エンドエフェクターに カセット内のウエハの位置を検出するマッピングセンサを 搭載しています。

<材質>

・ステージ:テフロン被覆硬質黒色アルマイト処理

・カセットガイドレール:ESDポリプロピレン ・エンドエフェクタ:硬質透明アルマイト処理 ・エンドエフェクタタッチパッド:カルレッツ



<オプション>

- ・SECS/GEMインターフェイス
- ・ウエハOCR IDリーダー統合
- ・ウエハアライメント

<対応ウエハサイズ>

100 mm

150 mm

200 mm

<特長>

- 省スペース(卓上型)
- ・ウエハ分割
- ・ウェハ統合
- ・ウエハ抜取
- ・ピッチ変更
- ・ウエハへのスクラッチ削減
- ・薄ウエハに対応 (最大2mm反りに対応可)
- ・MEMS、Taikoウエハに対応

ストレスのないエンドエフェクター

WS200のカルレッツ製パッド付きエンドエフェクターはマッピングセンサーが搭載されています。 ウエハの構造にストレスを与える真空を使用することなく化合物半導体あるいは薄ウエハのハンドリングが 可能です。高速搬送中でも、カルレッツ製パッドがエンドエフェクター上でウエハの動きを制御します。

簡単な制御

タッチスクリーンモニターの制御システムは多くの機能があります。 固有のレシピモード、クイック搬送または手動搬送プログラムを含む幅広いオプションに対応します。

安全機能

・マッピングエンドエフェクタ:ウエハ位置を識別します

・ロードエラーのマッピング : ウエハダブルスタック、クロススロットを検出します

・ウエハ飛び出しセンサー : 飛び出したウエハを検出します

・カセットインプレースセンサー:誤った位置に置かれたカセットを検出します

・ウエハ回復ソフトにより停電時にウエハをリセットします。

・静電気対策仕様としてカせットステージおよびエンドエフェクタへの帯電防止アース付属

Cleanroom Compatibility	ESD Safety	Transfer Speed	Power
ISOクラス3	対策あり	最大400wph	100-120VAC,24VDC



